ロ　一二以上のげっ歯類の動物又は二以上のげっ歯類以外の動物の鼻部を直接エアゾールを流動させて暴露することができるものであって、これに用いるように設計した動物を保定する密閉型のホルダーを有するもの

第三条第一号、第一号の二、第二号から第四号までの規定中「、試験装置」を「若しくは試験装置」に改め、同条第二号イ（三）中「液体ロケット推進装置」の下に「若しくはゲル状燃料ロケット推進装置」を、「液体ロケットエンジン」の下に「若しくはゲル状燃料ロケットモータ」を加え、同条第十一号イ中「又はファイバープレイスメント装置」を「、ファイバープレイスメント装置又はトウプレイスメント装置」に改め、同号ロ中「複合材料からなる航空機の機体又はロケットの構造体を製造するためのものであって、テープ又はシート」を「テープレイング装置であって、複合材料からなる航空機の機体又はロケットの構造体を製造するために、テープ」に改める。

第四条第一号を次のように改める。

一　ふっ素化合物の製品であって、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体に使用するように設計したもののうち、第十四号ロ又はハに該当するふっ素化合物の含有量が全重量の五〇パーセントを超えるシール、ガスケット、シーラント又は燃料貯蔵袋

第四条第七号中「基材の表面に定着させるコーティング用のもの」を「コーティングに使用するために特に調合したもの」に改め、同条第十一号中「作動油若しくは」及び「液体若しくは」を削り、同号イを次のように改める。

イ　削除

第四条第十四号イを次のように改める。

イ　削除

第五条第二号イを次のように改める。

イ　旋削をすることができる工作機械であって、輪郭制御をすることができる軸数が二以上のもののうち、次のいずれかに該当するもの（二）に該当するものを除く。）

（一）　移動量が一メートル未満の直線軸のうち、いずれか一軸以上の一方向位置決めの繰返し性が〇・〇〇〇九ミリメートル以下のもの

（二）　移動量が一メートル以上の直線軸のうち、いずれか一軸以上の一方向位置決めの繰返し性が〇・〇〇一ミリメートル以下のもの

（三）　棒材作業用の旋盤のうち、スピンドル貫通穴から材料を差し込み加工するものであって、次の1及び2に該当するもの

1　加工できる材料の最大直径が四二ミリメートル以下のもの

2　チャックを取り付けることができないもの

第五条第二号ロ（一）中「国際規格ＩＳＯ二三〇／二（二〇〇六）で定める測定方法により測定した場合に、いずれか一軸以上の直線軸の位置決め精度が〇・〇〇三ミリメートル以下のもの」を「次のいずれかに該当するもの」に改め、同号ロ（一）に次のように加える。

1　移動量が一メートル未満の直線軸のうち、いずれか一軸以上の一方向位置決めの繰返し性が〇・〇〇〇九ミリメートル以下のもの

2　移動量が一メートル以上の直線軸のうち、いずれか一軸以上の一方向位置決めの繰返し性が〇・〇〇一ミリメートル以下のもの

第五条第二号ロ（二）中「国際規格ＩＳＯ二三〇／二（二〇〇六）で定める測定方法により測定した場合に」を削り、同号ロ（二）1中「直線軸の位置決め精度が〇・〇〇三ミリメートル以下のもの」を「一方向位置決めの繰返し性が〇・〇〇〇九ミリメートル以下のもの」に改め、同号ロ（二）2中「二メートル未満」を「四メートル未満」に、「直線軸の位置決め精度が〇・〇〇四五ミリメートル以下のもの」を「一方向位置決めの繰返し性が〇・〇〇一四ミリメートル以下のもの」に改め、同号ロ（二）3中「二メートル以上」を「四メートル以上」に改め、「ミリメートルで表した」を削り、「直線軸の位置決め精度が、次の式により算出した数値以下のもの」を「一方向位置決めの繰返し性が〇・〇〇六ミリメートル以下のもの」に改め、「〇・〇〇四五＋〇・〇〇七×（Ｌ（メートルで表した直線軸の移動量）－二）」を削り、同号ロ（三）中「国際規格ＩＳＯ二三〇／二（二〇〇六）で定める測定方法により測定した場合に、」を削り、「位置決め精度が〇・〇〇三ミリメートル以下のもの」を「一方向位置決めの繰返し性が〇・〇〇一ミリメートル以下のもの」に改め、同号ハ中「動物又は二以上のげっ歯類以外の動物の鼻部を直接エアゾールを流動させて暴露することができるものであって、これに用いるように設計した動物を保定する密閉型のホルダーを有するもの」を「一方向位置決めの繰返し性が〇・〇〇一ミリメートル以下のもの」に改め、同号ハ（一）中「国際規格ＩＳＯ二三〇／二（二〇〇六）で定める測定方法により測定した場合に」を削り、「位置決め精度が〇・〇〇三ミリメートル以下」を「一方向位置決めの繰返し性が〇・〇〇一ミリメートル以下」に改め、同号ハ（二）中「五以上のもの」を「五以上のものであって、次のいずれかに該当するもの」に改め、同号ハ（二）に次のように加える。

1　移動量が一メートル未満の直線軸のうち、いずれか一軸以上の一方向位置決めの繰返し性が〇・〇〇一ミリメートル以下のもの

2　移動量が一メートル以上四メートル未満の直線軸のうち、いずれか一軸以上の一方向位置決めの繰返し性が〇・〇〇一四ミリメートル以下のもの

3　移動量が四メートル以上の直線軸のうち、いずれか一軸以上の一方向位置決めの繰返し性が〇・〇〇六ミリメートル以下のもの

第五条第二号ハ（四）中「国際規格ＩＳＯ二三〇／二（二〇〇六）で定める測定方法により測定したときの位置決め精度が〇・〇〇三ミリメートル未満」を「一方向位置決めの繰返し性が〇・〇〇一ミリメートル未満」に改め、同条第四号中「すべて」を「全て」に改め、同号ロ中「二乗平均」の下に「平方根」を加え、同条第八号ロを次のように改める。

ロ　直線上の変位を測定するためのものであって、次のいずれかに該当するもの

（一）　次の全てに該当するもの（レーザー干渉計（自動制御装置とともに使用するように設計したフィードバック機能を有しない干渉計であって、レーザーを用いて工作機械、測定装置又はこれらに類するもののスライド運動誤差を測定するものを除く。）及びレーザーを用いた光学エンコーダを含む。）

1　レーザー光を用いて測定することができるもの

2　測定できる最大の測定レンジにおいて、分解能が〇・二ナノメートル以下のもの

3　測定範囲内のいずれか一の点において、空気屈折率で補正した場合に、測定軸のナノメートルで表した測定の不確かさの数値がミリメートルで表した当該測定軸の長さに〇・〇〇〇五を乗じて得た数値に一・六を加えた数値以下のものであって、一九・九九度以上二〇・〇一度以下の温度範囲において三〇秒を超えて測定できるもの

（二）　（一）に該当するものの部分品であって、当該装置にフィードバック機能を付加するように設計したもの

第六条第一号ホ（一）2中「三〇〇メガサンプリング毎秒」を「五〇〇メガサンプリング毎秒」に改め、同号ホ（一）3中「分解能が一二ビット」の下に「以上一四ビット未満」を加え、同号ホ（一）4中「一二ビット超一四ビット以下」を「一四ビット以上一六ビット未満」に、「一二五メガサンプリング毎秒」を「二五〇メガサンプリング毎秒」に改め、同号ホ（一）5中「一四ビットを超えるもの」を「一六ビット以上のもの」に、「二〇メガサンプリング毎秒」を「六五メガサンプリング毎秒」に改め、同条第二号ヲ中「単測波帯位相雑音」を「単側波帯位相雑音」に改め、同条第五号ロ中「三〇〇ワット時毎キログラム」を「三五〇ワット時毎キログラム」に改め、同条第十号及び同条第十一号を次のように改める。

十　アナログデジタル変換器のうち、アナログデジタル変換を行う機能を有するモジュール、組立品又は装置（アナログデジタル変換カード、波形デジタイザー、データ収集カード、信号収集ボード及びトランジェントレコーダーを含む。）であって、次のイ及びロに該当するもの（デジタル方式の記録装置、サンプリングオシロスコープ、スペクトラムアナライザー、信号発生器、ネットワークアナライザー及びマイクロ波用試験受信機を除く。）

イ　分解能及びサンプリング速度が次のいずれかに該当するもの

（一）　分解能が八ビット以上一〇ビット未満のものであって、入力速度が一・三ギガサンプル毎秒を超えるもの

（二）　分解能が一〇ビット以上一二ビット未満のものであって、入力速度が一ギガサンプル毎秒を超えるもの